

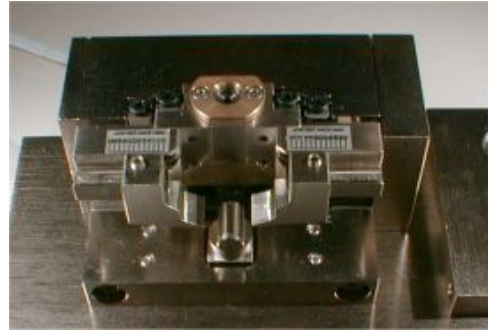
300N&2KN 垂直三、四点弯曲试验台

MICROTEST三、四点弯曲和拉伸/压缩模块是专门设计用于在扫描电子显微镜（SEM）、或光学显微镜下观察试样的高应力区域的装置。软件基于Windows操作系统，通过计算机显示屏设定驱动参数以及实时显示应力/应变曲线。负荷从2N到5KN，拉伸速率从0.02mm/min到50mm/min。所有模块都通过Microtest拉伸试验软件进行控制。根据用户的要求，也可订制特殊规格的产品。

概述



2KN垂直弯曲试验台



3KN垂直弯曲试验台

使用 Deben 试验模块，控制均通过 PC，使用 MICROTEST 拉伸试验软件来实现。

传统的三点弯曲试验中，试样支撑在远离中心的两点上，向下拉第三个中心点使试样发生变形。对于 SEM，我们反向使用该技术。

试样固定在中心点上，向下驱动两个远离中心的点。这样做有两个好处：高应变区在上部便于观察，另外，由于高度不变，高应变区保持在中心位置不动。

标准型的最大载荷是 300N(30Kg)，变形速度从 0.05mm/min 到 5mm/min。另外用户也可以选购最大载荷达 2KN 的。标准试样宽度是 40mm，上下夹具可以根据不同的试样改变，例如可以换成四点弯曲夹具进行缺口研究。

该模块设计仅用于垂直三点弯曲，若用于水平三点弯曲，我们推荐使用拉伸台选配三点或四点弯曲附具。